金型加工技術・微細転写加工技術とその応用に関する研究 (第2報)

山田 博之·小松 利安·勝又 信行·石田 正文·宮川 和幸·木島 一広·岩間 貴司·吉田 善一*1

Study on Fabrication Technology for Microdies and Transcription Molding of Micro-pattern and Application (2nd Report)

Hiroyuki YAMADA, Toshiyasu KOMATSU, Nobuyuki KATSUMATA, Masafumi ISHIDA, Wako MIYAGAWA, Kazuhiro KIJIMA, Takashi IWAMA and Yoshikazu YOSHIDA *1

要 約

マイクロ関連部品は、要求される加工精度が高いため、材料への直接加工により小ロット製造されている場合が多いが、製造コストが高くなるため、微細転写加工による量産化技術が注目されている。しかし、実用化にはまだ多くの課題が残っている。そこで、本研究では転写型のマイクロ加工技術や微細研磨加工技術等の各種要素技術について検討を行った。はじめに、金属製転写型の作製を目的として、切削加工および放電加工による金属材料へのマイクロ加工技術を検討した。その結果、幅 $100\,\mu\mathrm{m}$ 、高さ $100\,\mu\mathrm{m}$ の微小リブが加工でき、マイクロ金型作製技術への適用可能性を把握した。また、転写型への適用を目的として耐熱性や耐薬品性に優れたグラッシーカーボンへのエキシマレーザ加工技術を検討した。その結果、レーザによるグラッシーカーボンへの微細加工の可能性を確認でき、基本的な加工条件を把握した。さらに、微小部分の表面処理技術として、磁性砥粒を 2 軸揺動させた磁気援用研磨加工を検討した。その結果、1 軸揺動に比べて表面粗さがより一層向上することを確認できた。

1. 緒 言

近年、マイクロテクノロジーは様々な分野への応用が 期待されている。多くのマイクロ部品は、要求される加 工サイズや加工精度が高いため、各種微細加工機を用い て小ロット加工により試作・製造が行われている場合が 多い. しかし. 材料への直接加工では製造コストが高く なり、今後は微細転写加工による量産化技術の必要性が 高くなると考えられる. 現在, 半導体製造技術を応用し たマイクロ金型作製技術に関する研究、ホットエンボス 法やインプリント法などの転写加工技術に関する研究が 盛んに行われている. 1)-3) しかし, 実用化にはまだ多く の課題が残されており、代表的な課題として以下に示す 項目を解決する必要性が考えられる. ①転写加工用マイ クロ金型の作製に適した加工技術と材料の選定, ②マイ クロ金型の品質(耐久性,離型性など)向上,③材料に 応じた転写加工条件の最適化とタクトタイムの向上, ④ 実用化に向けて研究開発段階である微細転写加工技術の 確立、⑤マイクロテクノロジーの各種応用分野における 量産化技術の適用などがある.

本研究では、数十 μ mから数百 μ mのマイクロ形状を有する部品の加工を主なターゲットとし、マイクロ金型

を作製するための各種マイクロ加工技術や研磨加工技術の検討と、微細転写加工技術の検討を目的とした。第1報⁴⁾では、耐熱性などに優れているが切削などの機械加工が難しいグラッシーカーボン(ガラス状炭素材料)にレーザ加工を適用し、基本的な加工条件を把握した。また、微小部分の表面処理技術として、混合磁性体を用いた磁気援用研磨加工を検討した。さらに、金型の微小部分における洗浄方法として、マイクロバブルを利用した手法を検討し、洗浄能力の向上を確認した。

本報では、第1報に引き続きグラッシーカーボンへのレーザ加工について、加工形状や寸法精度からマイクロ金型への適用可能性を検討した。また、金属製転写型の作製を目的として、切削加工および放電加工による金属材料へのマイクロ加工技術を検討した。また、各種加工時に発生する微小なバリの除去や、離型性を向上させるために微小部分の表面処理技術が必要になる。第1報で金属製の型に対する磁気援用研磨加工について報告したが、本報では磁性砥粒を2軸揺動させた場合の磁気援用研磨加工について検討を行ったので報告する。

2. 金属材料へのマイクロ加工

2-1 実験方法

金属製転写型の作製を目的として、金属材料へのマイ

^{*1} 東洋大学理工学部生体医工学科

クロ加工技術を検討した.本報では、切削加工および放電加工による金属へのマイクロ加工・高精密加工を試みた.切削加工では金型鋼として使用されているNAK55を型材料に用い、放電加工ではガラスと熱膨張係数が近く難削材であるKovarを型材料に用いた.切削加工実験ではマシニングセンタ(三井精機工業㈱製、VU50A)を使用し、放電加工実験では微細放電加工機(三菱電機㈱製、EDSCAN8E)を使用した.マイクロ流体デバイスなどで利用される微細溝を有した部品を転写加工によって作製することを目標とし、型形状として断面が100×100μmの微小リブの加工を試みた.加工条件を表1および表2に示す.

≠ : 1	微力	. 11	-in	小田田	Hinn	女 /
<i>★</i>	l 1π¥/I	11	10.	MILLE	1 <i>1</i>	२ २11+

20 1 100 1 100 100 100 100 100 100 100 1			
加工装置		マシニングセンタ 三井精機工業㈱製,VU50A	
荒加工	工具	超鋼 TSコート (ミスミ製:TSC-HP-MS) スクエアエンドミル φ 6 mm	
	切削速度	約60m/min	
	送り速度	1000mm/min	
仕上げ加工	工具	超鋼FXコーティング (OSG製: FX-MG-EMS) スクエアエンドミル φ 3 mm	
	切削速度	約50m/min	
	送り速度	125mm/min	
	切り込み	0.1mm	

表 2 微小リブの放電加工条件

加工装置		微細放電加工機 三菱電機㈱製,EDSCAN8E	
放電条件	設定電圧	80V	
	静電容量	0pF	
加工条件	電 極	銅パイプ(φ 2.0mm)	
	Z送り量	0.2mm	
	加工速度	任意 (最適送り)	
	加工時間	約113時間	
	電極消耗量	0.1121mm	

また、切削加工において発生するバリが転写加工時に影響を及ぼすことが予想される。そこで本研究では、核(コア径:0.2~0.5mm)となる弾性体の表面に研磨 微粉を付着させた表面積層型の弾性研磨材を用いて加工 物表面を乾式の擦過現象によって研磨加工することができるブラスト加工機を用いて、バリの除去を検討した。実験では鏡面ブラスト加工機(東洋研磨材工業㈱製、SMAP-II)を用いた。ブラスト加工条件を表3に示す。

表 3 ブラスト加工条件

加工装置	鏡面ブラスト加工機 東洋研磨材工業㈱製,SMAP-Ⅱ
砥 粒	仕上げ加工メディア SP-F100D (#10000ダイヤモンド砥粒)
インバータ周波数	40, 50Hz
加工送り	手動
加工時間	10sec

2-2 結果

金型鋼として使用されているNAK55材料に、切削加工により $100\times100\,\mu$ mの微小リブを加工した。表1に示す条件で切削加工した微小リブの電子顕微鏡観察写真を図1に示す。目標とする加工形状が得られたが、リブの上面に微細なバリが発生することが分かった。また、加工面の表面粗さは $0.147\,\mu$ mRaである。微細転写加工用マイクロ金型としてバリの除去や表面粗さの改善が必要であるため、それらに関する検討結果を後述する。

次に、ガラスと熱膨張係数が近いKovarに、放電加工により $100\times100\mu m$ の微小リブを加工した。表 2に示す条件で放電加工した微小リブの電子顕微鏡観察写真を図 2に示す。加工面の表面粗さは $0.142\mu m$ Raであり、切削加工と同程度の加工面粗さが得られた。ただし、リブの根元部分が僅かに R 形状になっており、これは放電集中による電極磨耗の影響であると推測される。

次に、切削加工において発生するバリの除去について 検討を行った。鏡面ブラスト加工機を用いて鏡面加工を 行う場合は、荒加工・中仕上加工・仕上加工など加工面 の状態に応じた研磨材を段階的に使用する。しかし、本

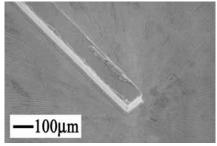


図1 NAK55への微小リブの切削加工例

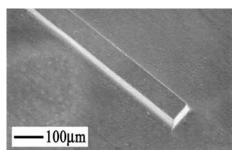
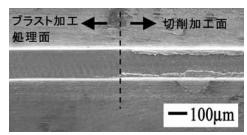
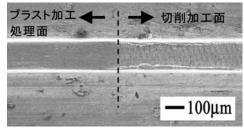


図2 Kovarへの微小リブの微細放電加工例



(a) インバータ周波数40Hzの場合



(b) インバータ周波数50Hzの場合 図3 切削加工面へのブラスト加工結果

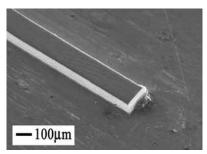


図4 ブラスト加工処理後の微小リブ

研究ではバリの除去を目的とし, かつ微小リブの形状 に対する影響が少ないように、仕上用メディアのみを用 いて切削加工部分にブラスト加工を行った. 加工実験で は、微小リブの半分にマスキングしてブラスト加工を行 うことにより、切削加工面とブラスト加工処理面との比 較を行った. 砥粒噴射装置のインバータ周波数を40Hz と50Hzに設定した条件でブラスト加工を行ったサンプ ルの電子顕微鏡観察写真を図3(a),(b)にそれぞれ示 す. 40Hzと50Hzの両条件ともに切削加工時に発生した バリを除去でき、表面粗さについても多少改善された. ただし、インバータ周波数50Hzの条件のように砥粒噴 射が強い場合には、微小リブのエッジ部にダレが発生す ることが確認された. また, ブラスト加工後のサンプル を電子顕微鏡で観察した鳥瞰写真を図4に示す. リブ 寸法に対して砥粒径が大きいため、リブ側面などに対し てはブラスト加工の効果が小さいことが分かった. 今後 は、表面粗さの改善について切削加工条件の最適化とと もに他の処理方法も検討する.

3. グラッシーカーボンへのマイクロ加工 3-1 実験方法

転写型材料として耐熱性や耐薬品性に優れたグラッシ

ーカーボンに注目した. 一般的にグラッシーカーボンは 切削などの機械加工が難しいため、レーザによるマイク ロ加工を検討した. グラッシーカーボンには、東海カー ボン㈱製GC-20SSを用い、表面を鏡面研磨加工した材 料をレーザ加工実験に用いた. レーザには、アブレーシ ョン加工が可能でマイクロ加工に適した紫外レーザとし て、エキシマレーザに注目した、本実験ではエキシマレ ーザ加工機 (Exitech社製, PS2000) 発振器 (LAMBDA PHYSIK社製、LPX200i) を用いた、波長は248nm、 パルス幅は20nsec, 発振器の1パルスあたりのレーザ パワーは150~280mJとし、さらに減衰器によってレー ザパワーを調節した. また、ビームは光学系にアパーチ ャを挿入して成形し、縮小光学系レンズによって集光し た.

第1報では、エキシマレーザによるグラッシーカーボ ンへの加工状態の向上と基本的なマイクロ加工条件を把 握することを目的として、20×20μmの微小穴の加工条 件について検討した. 本報では、穴寸法の影響を調べる ために100×100μmの微小穴の加工条件について検討し た. 加工条件を表4に示す. ビーム形状は焦点位置で約 $100 \times 100 \,\mu$ mとした. レーザのフルエンスを 2.0J/cm^2 か ら7.0J/cm²まで変化させた場合の加工状態への影響につ いて検討した。また、レーザの照射パルス数を10pulses から100pulsesまで変化させた場合の加工状態への影響 について検討した. さらに、加工ステージを移動させる ことによって、幅100μmの微小リブの加工を試みた. ビーム形状は焦点位置で約1×1mmとした.

また、微細立体形状の作製を目的として、アノード酸 化処理によるアルミ薄膜をハーフトーンマスクに応用し て、グラッシーカーボンへの微細構造のレーザ加工も試 みた.

表 4 微小穴のレーザ加工条件

エキシマレーザ加工機 Exitech社製, PS2000 加工装置

加工公区	(発振器 LAMBDA PHYSIK社製, LPX200i)		
レーザ波長	248nm		
縮小光学系倍率	10倍レンズ系(1/10縮小)		
ビーム形状	$100\mu\mathrm{m}\! imes\!100\mu\mathrm{m}$		
発振周波数	50Hz		
フルエンス	2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0J/cm ²		
照射パルス数	10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100		

3-2 結果

エキシマレーザによってグラッシーカーボンへ微小穴 を加工する場合の加工条件と加工状態との関係について 検討した. レーザ照射パルス数を10pulsesとした場合の レーザフルエンスと穴加工深さとの関係を図5に示す.

第1報で報告した20×20μmの微小穴を加工する場合と 比較した、加工深さとフルエンスとはほぼ比例関係であ るが、100×100μmの微小穴を加工した方が、加工深さ は小さくなることが分かった. 穴寸法が大きくなると 除去体積も大きくなり、加工時に発生する飛散物が穴外 部へ排出されにくくなることが影響していると推測され る. また、レーザフルエンスを 5 J/cm²とした場合のレ ーザ照射パルス数と穴加工深さとの関係を図6に示す. 図7(a),(b) は20×20 μmの微小穴を加工した場合、 図7(c),(d)は100×100 µmの微小穴を加工した場合 の加工穴の電子顕微鏡観察写真である. 加工深さとレー ザ照射パルス数とはほぼ比例関係であることが確認でき た. これらの結果から、開口寸法が100 µmでアスペク ト比(穴の開口寸法と深さ寸法の比)が1前後までの穴 形状では、加工条件による加工深さの制御が容易である と予想される. ただし、アスペクト比が増加するほど、 または、穴寸法が増加するほど、穴側面がテーパ形状に なり易く、穴周辺におけるデブリの堆積も多くなること が分かった. これらも、加工時に発生する飛散物が穴外 部へ排出されにくいことが影響していると推測される.

次に、これらの加工条件をもとに、幅100μmの微小 リブのレーザ加工を試みた、焦点位置でのビーム形状を

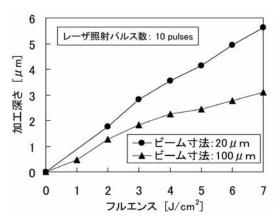


図5 微小穴の加工深さとレーザフルエンスとの関係

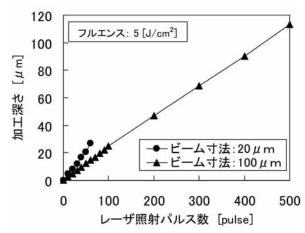


図6 微小穴の加工深さとレーザ照射パルス数との関係

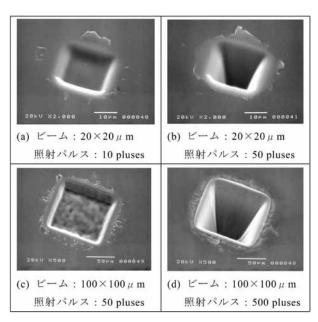


図5 微小穴の加工深さとレーザフルエンスとの関係

 $1 \times 1 \text{ mm}$ としてスキャン加工を行い,微小リブ部分を残す除去加工を行った.表 5 に示す条件でグラッシーカーボンに加工した微小リブの電子顕微鏡観察写真を図 8 に示す.深さ約 $100 \, \mu$ mのリブが加工できたが,側面はテーパ形状である.ただし,転写加工時には抜け勾配が必要となるため,今後は抜け勾配として必要な角度を検討し,転写加工形状に適したテーパ形状が得られるように加工条件をさらに検討する必要がある.また,リブ上面にデブリの堆積が観察されるため,今後はデブリの対策についても検討する必要がある.

次に、微細立体形状を作製するため、アノード酸化処理によるアルミ薄膜 $^{5),6}$ をレーザ加工用ハーフトーンマスクに応用する実験を試みた.膜厚を変化させたアルミ薄膜を光学石英ガラス板上に成膜したマスクを作製し、そのマスクを用いてエキシマレーザの強度分布を変化させることにより、グラッシーカーボンに微細立体形状を加工することを検討した.表 6 に示す条件でレーザ加工を行った.図 9 の電子顕微鏡観察写真に示すような幅 $20\,\mu$ m、高さ $10\,\mu$ mの複数の突起形状をグラッシーカーボンに加工することができた.今後は、加工条件をさらに検討するとともに、転写加工の検討を行う.

表 5 微小リブのレーザ加工条件

レーザ波長	248nm
縮小光学系倍率	10倍レンズ系(1/10縮小)
ビーム形状	1 mm× 1 mm
発振周波数	50Hz
フルエンス	5.0J/cm²
ステージ移動速度	17.82mm/min
パス数	6

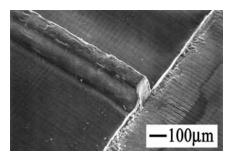


図8 グラッシーカーボンへの微小リブ加工例

表 6 微細立体形状のレーザ加工条件

レーザ波長	248nm
縮小光学系倍率	10倍レンズ系(1/10縮小)
マスク基板	光学石英ガラス
マスク材質	アルミ薄膜
発振周波数	50Hz
フルエンス	5.0J/cm²
照射パルス数	100pluses

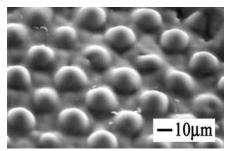


図9 グラッシーカーボンへの微細立体形状加工例

4. マイクロ金型研磨加工技術

4-1 実験方法

磁気援用研磨加工法は、円筒内面の精密仕上げや、複雑な曲面形状を有する部品の精密仕上げ等に広く応用されている⁷⁾. 本研究では、マイクロ金型の微細形状部分における微細バリの除去や加工面あらさの向上を目的に金属材料(SUS304)への磁気援用研磨加工法の適用を検討した。

図10に磁気援用研磨加工法の模式図を示す.磁石から発生する磁力により磁性粒体を被加工物に押しつけ,磁性粒体を揺動させて加工物表面を研磨加工する方法である.第1報では被加工物を固定して磁石のみを揺動させていたが、本報では加工面品質の更なる向上を目指して、被加工物と磁石をそれぞれ直交方向に揺動させて、研磨加工する方法を検討した.

表7に加工条件を示す.磁石は簡易的な機構とするため永久磁石とし、且つ磁石と磁性粒体の間に十分な磁気吸引力を発生させるためにネオジウム磁石を使用した.安定した揺動運動を行うため電磁式振動試験機(エミック㈱社製, VC-10DMAX (32) P1R) を使用した.

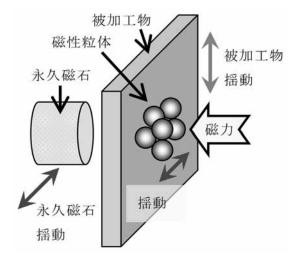
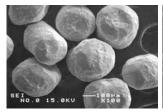


図10 磁気援用研磨加工法の模式図

表 7 磁気援用研磨加工条件

被加工物	SUS304 (20×30×0.5mm)		
揺動条件	被加工物:周波数 5 Hz 20mmP-P 永久磁石:周波数33Hz 4 mmP-P		
磁極	ネオジウム永久磁石:10× 5 ×40mm		
磁性粒体	ステンレスボール:平均粒径0.3mm WA混合磁性砥粒:平均粒径0.08mm		
研磨方式	乾式		
間隙	約4mm (磁石と磁性砥粒間)		



SEI NO.1 15 BKU — 189Wa...

(a) ステンレスボール

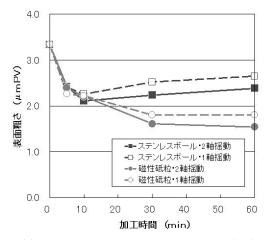
(b) WA混合磁性砥粒

図11 磁気援用研磨加工に用いた磁性粒体

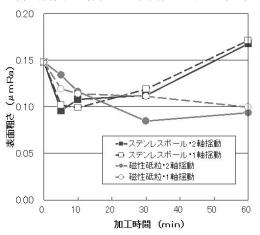
使用した磁性粒体は、図11 (a) に示す直径約0.3mm のステンレスボールと、図11 (b) に示すWA混合磁性 砥粒を使用した. 各磁性粒体を約0.1g使用して、乾式で 研磨加工を行った.

4-2 結果

加工時間による表面粗さの変化について.実験結果を図12に示す. (a) に記載されている表面粗さPVは,最大粗さに相当する値である.全体的に,磁性粒体はステンレスボールより磁性砥粒を使用した方が,加工面品質が向上することが分かった.特に,ステンレスボールを用いた場合,表面粗さPVの数値は低下するが,表面粗さRaで評価すると,加工時間の増加により表面品質が悪化する現象が見られた.この原因は,ステンレスボールが被加工物の表面を転がり,極表層部の微細な凹凸を



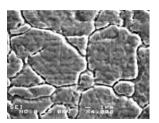
(a) 研磨加工時間による表面粗さの向上 (PV)



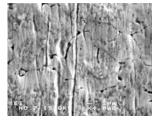
(b) 研磨加工時間による表面粗さの向上 (Ra) 図12 磁気援用研磨加工による表面粗さの向上

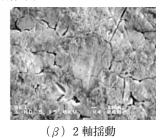
押し潰すだけで、被加工物自体を除去加工していないためと考えられる。また、すべての加工条件において、加工時間が30分以上経過すると、表面粗さの値はほぼ一定になることも分かった。さらに、1 軸揺動の場合より2 軸揺動の方が、表面粗さの値が低くなり、加工面品質を向上させることも分かった。

電子顕微鏡で各加工条件による表面の状態について観察した結果を図13に示す。被加工物は縦方向に揺動させている。ステンレスボールを用いた場合、初期表面と比較して、表面の微細な凹凸は滑らかになったが、大きな溝はほぼ初期表面の状態と変わらないことが分かった。これは、ステンレスボールは被加工物の表面を転がり、極表層部の微細な凹凸を押し潰すだけで、被加工物自体を除去加工しない、という前述した考察と良く一致した結果である。また、1 軸揺動の場合は、揺動方向に加工痕が発生しているが、2 軸揺動の場合は、全体的に均一な加工面になっていることが確認できた。



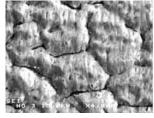
(a) 初期表面





(α) 1 軸揺動

(b) ステンレスボールを用いた場合





(α) 1 軸揺動

(β) 2 軸揺動

(c) 磁性砥粒を用いた場合 図13 電子顕微鏡による表面観察

5. 結 言

微細転写加工用型の作製を目的としてマイクロ加工技術や研磨加工技術などの各種要素技術について検討を行った. 得られた結果は以下のとおりである.

- (1) 金属製マイクロ金型への適用を目的として、切削加工および放電加工によるマイクロ加工を検討した。その結果、幅 $100\,\mu\,\mathrm{m}$ 、高さ $100\,\mu\,\mathrm{m}$ の微小リブが加工でき、マイクロ金型作製技術への適用可能性を把握した
- (2) 鏡面ブラスト加工において、仕上用メディアのみを 用いて切削加工面にブラスト加工を行うことによ り、切削加工時に発生した微細バリを除去できた.
- (3) エキシマレーザにより、耐熱性や耐薬品性に優れたグラッシーカーボンへの加工を検討した。その結果、基本的な加工条件を把握し、幅 $100\,\mu\,\mathrm{m}$ 、高さ $100\,\mu\,\mathrm{m}$ の微小リブ加工を実現した。
- (4) アノード酸化処理によるアルミ薄膜をエキシマレー ザ用マスクに応用して、レーザによって幅 $20\,\mu$ m、高さ $10\,\mu$ mの複数の突起形状をグラッシーカーボン に加工することができた.
- (5) 加工面粗さの向上を目的として、SUS304板材を 5 Hz, 永久磁石を33Hzで揺動させた磁気援用研磨 加工を行った結果、次のことが分かった.
 - ・ステンレスボールを用いた場合、被加工物の極表

層部の凹凸を除去するだけで、表面粗さが逆に悪 くなる場合がある.

- ・30分以上の磁気援用研磨加工では、大幅な表面粗さの向上は認められなかった.
- ・永久磁石の揺動による表面粗さ向上は認められた.

今後は、数十 μ mから数百 μ mのマイクロ形状を有する部品の加工を主なターゲットとして、マイクロ金型の試作を検討するとともに、微細転写加工技術について検討を行う.

参考文献

- 1) (社高分子学会編: 微細加工技術 [応用編], (株)エヌ・ティー・エス, p.147 (2003)
- 早乙女康典:マイクロ塑性加エーマイクロ塑性加工技術の現状と展望ー,精密工学会誌,Vol.69, No.9,p.1221 (2003)
- 3) 前田龍太郎,他5名:ナノインプリントのはなし, 日刊工業新聞社,p.8 (2005)
- 4) 山田 博之, 小松 利安, 岩間 貴司, 勝又 信行, 宮川 和幸, 萩原 茂, 木島 一広, 吉田 善一: 金型加工技術・微細転写加工技術とその応用に関す る研究(第1報), 山梨県工業技術センター研究報 告, No.23, p.113 (2009)
- 5) 勝又 信行,石田 正文,斎藤 修:薄膜形成法 を用いたナノ加工技術の研究(第2報),山梨県工 業技術センター研究報告,No.21,p.33 (2007)
- 6) 勝又 信行,石田 正文:電解処理法による微細構造体作製技術の開発,山梨県工業技術センター研究報告,No.22,p.44 (2008)
- 7) シュウエンカ,進村武男名:定圧磁気ブラシを利用 した新しい平面磁気研磨法に関する研究,砥粒加工 学会誌, Vol.53, No.1, p.33 (2009)